УДК 621.9.047

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ АНОДНО-АБРАЗИВНОМ ПОЛИРОВАНИИ КАНАЛОВ ВОЛНОВОДОВ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ

^{1,2}Трифанов В.И., ²Суханова О.А., ²Карелина Е.А., ²Шестаков И.Я.

¹ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Москва, e-mail: sibgau-uks@mail.ru; ²ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, e-mail: sibgau-uks@mail.ru

Рассматривается проблема снижения и выравнивания шероховатости поверхности каналов труб малого сечения анодно-абразивным полированием (ААП). Изготовление каналов труб малого сечения волочением приводит к неравномерной шероховатости поверхности в поперечном направлении Ra = 0,24 мкм, в продольном направлении Ra = 0,16 мкм, что требует снижения и выравнивания шероховатости. Предметом исследования является аналитическое определение влияния параметров анодно-абразивного полирования на снижение шероховатости поверхности каналов труб малого сечения. Анодно-абразивного полирования на снижение шероховатости поверхности каналов труб малого сечения. Анодно-абразивное полирования обрабатываемой поверхности осуществляется при совместном абразивнои и анодном воздействии импульсным током на микронеровности обрабатываемой поверхности. При колебании эластичного абразивонесущего катода-инструмента (ЭАКИ), изготовленного из синтетического каучука, смешанного с абразивом электрокорунда с зернистостью 40–28 мкм, и катода, выполненного из графита, создается бегущее импульсное электрическое поле и происходит абразивное удление оксидной пленки толщиной 0,01 мкм с микронеровностями обрабатываемой поверхности в проточном электроите 15% NaNO₃. При этом повышается степень локализации анодного растворения микронеровностей с сохранением исходной точности канала ± 0,02 мм и удалением минимального припуска. Для исследования используются схема анодно-абразивноги.

Ключевые слова: анодно-абразивное полирование, плотность тока, скважность импульсов тока, абразивное полирование

ANALYTICAL DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS DURING ANODIC-ABRASIVE POLISHING OF WAVEGUIDE CHANNELS OF SMALL CROSS-SECTION ^{1,2}Trifanov V.I., ²Sukhanova O.A., ²Karelina E.A., ²Shestakov I.Ya.

¹Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: sibgau-uks@mail.ru; ²Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, e-mail: sibgau-uks@mail.ru

The problem of reducing and leveling the surface roughness of small-section pipe channels by anodic-abrasive polishing is considered (AAP). The production of channels of pipes of small cross-section by drawing leads to uneven surface roughness in the transverse direction Ra = 0.24 microns, in the longitudinal direction Ra = 0.16 microns, which requires reducing and leveling the roughness. The subject of the study is the analytical determination of the influence of the parameters of anodic-abrasive polishing on the reduction of the surface roughness of the channels of pipes of small cross-section. Anodic-abrasive polishing of the treated surface is carried out with the combined abrasive and anodic action of pulsed current on the micro-roughness of the surface. When an elastic abrasive-bearing cathode-tool (EACT) made of graphite vibrates, a traveling pulsed electric field is created and an abrasive removal of an oxide film with a thickness of 0.01 microns with micro-dimensions of the treated surface in a flowing electrolyte of 15% NaNO₃. At the same time, the degree of localization of the anodic dissolution of micro-dimensions increases while maintaining the sinitial accuracy of the channel \pm 0.02 mm and removing the minimum allowance. For the study, the scheme of anodic-abrasive polishing, analytical dependences of AAP, as well as a formula for assessing surface roughness are used.

Keywords: anode-abrasive polishing, current density, current pulse duty cycle, abrasive polishing

Актуальной проблемой является снижение и выравнивание шероховатости поверхности каналов труб малого сечения после их изготовления волочением или деформирующим протягиванием.

Целью настоящей работы является получение и анализ формулы для расчета снижения и выравнивания шероховатости обрабатываемой поверхности каналов при анодно-абразивном полировании (ААП).

Материалы и методы исследования

В настоящей работе при рассмотрении уменьшения и выравнивания шероховатости поверхности анодно-абразивным полированием исследуется зависимость установившейся шероховатости в процессе анодного растворения микронеровностей бегущим импульсным электрическим током в проточном пассивирующем электролите 15% NaNO₃, а также формирование шероховатости поверхности за счет удаления оксидной пленки абразивными зернами эластичного абразивонесущего катода-инструмента (ЭАКИ).

На основе указанных исследований получена формула для оценки шероховатости поверхности при анодно-абразивном полировании каналов труб малого сечения, выполненных из сплава 32НКД.

Для уменьшения и выравнивания шероховатости поверхности каналов малого сечения, например 7х4 мм, 5х3 мм, может быть применен метод анодно-абразивного полирования (АПП) импульсным током [1]. Анодно-абразивное полирование [2] представляет собой совмещенный процесс анодного растворения микронеровностей под действием импульсного электрического тока в пассивирующем проточном электролите 6–15% NaNO₃, при одновременной активации гребешков микронеровностей путем удаления пассивирующей анодной пленки толщиной 0,01-0,1 мкм абразивонесущей частью эластичного катода – инструмента (АЭКИ) путем колебания его с частотой 20-50 Гц с перемещением в продольном направлении со скоростью 60-120 мм/мин. При этом создается бегущее импульсное электрическое поле на обрабатываемой поверхности с импульсным напряжением U(t) [2–4]:

$$U(t) = U_n(1 - e^{-\frac{t_u}{T_c}}),$$
 (1)

где T_c – постоянная времени спада, с; U_n – напряжение на электродах от источников постоянного тока, В; t_u – длительность импульса напряжения, с.

Величина среднего импульса тока I_{uv} , создаваемого импульсным напряжением U(t), может быть определена по формуле

$$I_{tu} = \frac{1}{t_u} \int_0^{t_u} I(t) dt, \qquad (2)$$

где $I(t) = I_0 e^{-(t_u/T_c)}$ – кривая тока от времени в импульсе; I_0 – максимальный ток в импульсе; T_c – постоянная времени спада тока в импульсе.

Применение импульсного тока позволяет повысить степень локализации анодного растворения микронеровностей, стабилизировать параметры электролита в межэлектродном зазоре, обеспечить сохранение исходной точности и формирование равномерной шероховатости поверхности по длине обрабатываемого канала [3].

На степень локализации при анодном растворении микронеровностей влияют различное распределение на микровыступах и микровпадинах плотности тока, выхода по току, эффективной электропроводности электролита, а также величина межэлектродного зазора. В пассивирующем электролите 15% NaNO₃ падение напряжения на микровыступах ΔU_m может составлять до 1,7 В, а на микровпадинах ΔU_d – до 2,8 В в зависимости от марки обрабатываемого материала, высоты и профиля микронеровностей, а также пассивационных процессов. Плотность тока на микровыступах и микровпадинах может отличаться в 8 раз [3]. При этом для получения требуемой шероховатости поверхности необходимо знать минимальный удаляемый припуск Z_{pin} в зависимости от исходной и конечной шероховатости поверхности. Минимальный удаляемый припуск Z_{min} определяют по формуле

$$Z_{\min} = k_z \delta_o Ln\left(\frac{R_{ucx}}{R_{\kappa}}\right), \qquad (3)$$

где δ_0 – начальный межэлектродный зазор, мм; R_{ucx} , R_{κ} – соответственно исходная и конечная шероховатости поверхности, мкм, k_z – коэффициент, учитывающий механизм ААП и вид обрабатываемого материала, $(k_z = 0, 1-0, 15)$.

Уменьшение шероховатости поверхности при анодном удалении припуска следует оценивать с учетом коэффициента локализации *K*, который зависит от условий электрохимического растворения микровыступов и микровпадин обрабатываемой поверхности.

Коэффициент локализации можно определить по формуле (4)

$$K_{L} = \frac{K_{i} \cdot d_{i}}{Z \min dt} = \left(R_{ucx} + \frac{\eta_{d} \varepsilon_{d}}{\gamma_{d}} \int_{0}^{t_{u}} i_{d} dt - \frac{\eta_{m} \varepsilon_{m}}{\gamma_{m}} \int_{0}^{t_{u}} i_{m} dt \right) / Z \min = \frac{\Delta R K_{i}}{Z \min} , \qquad (4)$$

где ε_m , ε_d – электрохимический эквивалент растворения металла на микронеровностях и во впадинах обрабатываемой поверхности; γ_m , γ_d – плотность продуктов растворения на микронеровностях и во впадинах; t_u – длительность импульса тока; i_m , i_d – плотности тока на микронеровностях и во впадинах; Z_{\min} – величина минимального удаляемого припуска; K_i – коэффициент, учитывающий условия электрохимической обработки, K_i = 8-10; ΔR – изменение шероховатости поверхности, $\Delta R = R_{ucx} - R_{ycm}$.

Необходимо отметить, что отношение плотностей тока i_d / i_m в процессе выравнивания шероховатости поверхности и изменения угла профиля микронеровностей может существенно изменяться и влиять на локализацию процесса анодного растворения. Высокую роль при этом играют частота и амплитуда импульсного напряжения U, скважность импульсов тока S, соотношение длительности импульсов t_u и паузы t_n [4–6].

Скважность следования импульсов напряжения и тока S рассчитывают по формуле

$$S = T_u / t_n, \qquad (5)$$

где *T_и* – период импульсов напряжения и тока.

Импульсы напряжения с прямым передним фронтом, что экспериментально подтверждено [7], свидетельствуют об активации гребешков микронеровностей абразивонесущей поверхностью эластичного катода-инструмента (рис. 1).



Рис. 1. Изменение импульсного напряжения $U_a = 6B$ в межэлектродном промежутке при ААП сплава 32НКД с режимами: A = 15-17 мм, f = 20 Гц, $t_u = 3$ мс

Установившуюся шероховатость поверхности от величины снимаемого слоя металла электрохимическим способом при средней плотности тока *i* и среднем напряжении U_c на электродах, можно определить с учетом коэффициента локализации и скважности импульсов тока по формуле [8]:

$$Ra_{ycm} = \frac{K_{l}\varepsilon_{\nu}\eta iT_{0}}{8\cdot S} = K_{l}\frac{\varepsilon_{\nu}\eta (U_{c} - \Delta U)\chi \cdot 10^{-4}T_{0}}{8\cdot S\cdot \delta_{_{M33}}}, \text{ MKM} \quad (6)$$

где U – среднее напряжение на электродах, В; ΔU – среднее падение напряжения в приэлектродных слоях, равное алгебраической сумме падений напряжений в прикатодных слоях, В; χ – удельная проводимость электролита, 1/см·Ом; $\delta_{_{M33}}$ – величина межэлектродного зазора, см; T_0 – время анодноабразивной обработки, с; K_1 – коэффициент локализации процесса анодного растворения; *S* – скважность импульсов тока.

Удаление оксидной пленки с гребешков и активация микронеровностей обрабатываемой поверхности при ААП осуществляется абразивными зернами ЭАКИ, совершающим продольные колебания с амплитудой A = 15-17 мм, частотой 20–50 Гц, длительностью импульсов тока $t_u = 3$ мс. Сила P_a , прижимающая зерно абразива, возникает за счет упруго-восстановительной силы эластичного абразивонесущего катода-инструмента, перемещающегося навстречу потоку электролита.

Схема процесса взаимодействия единичного зерна с микронеровностями при ААП показана на рис. 2 [9].

Мощность абразивного резания N_p можно оценить по формуле

$$N_{p} = M_{p} \cdot \omega, (\mathrm{H} \cdot \mathrm{M})/\mathrm{c}, \tag{7}$$

где ω – частота продольных колебаний АЭКИ, 1/с; M_p – момент резания, Н·м.

Момент резания M_p рассчитывался по формуле

$$M_{p} = P_{p} \cdot r, \, \mathrm{H} \cdot \mathrm{M}, \tag{8}$$

где P_p – сила резания, r – радиус абразивного зерна.

Используя модель взаимодействия единичного зерна с упругопластичным материалом, силу P_n можно представить [10–12]:

$$P_p = P_a \cdot f \cdot S_u, \,\mathrm{H},\tag{9}$$

где P_a – сила давления на зерно, Н/мм²; S_u – площадь абразивонесущего катода-инструмента; f – коэффициент трения.

Подставив выражение (9) в формулу (8), получим

$$M_{p} = P_{a} \cdot f \cdot S_{u} \cdot r , \text{H·M.}$$
(10)

С учетом выражения (9) N_p согласно формуле (10) можно представить в виде

$$N_p = P_a \cdot f \cdot S_u \cdot r \cdot \omega, \text{(H·M)/c.}$$
(11)

Отклонение профиля установившейся шероховатости обрабатываемой поверхности после n циклов абразивного полирования определяется по формуле

$$R_{a_{ycm}} = k_y \left(\frac{h_{\max}\omega}{W \cdot A}\right)^{1/2}, \frac{M}{c}, \qquad (12)$$

где h_{\max} — максимальная глубина внедрения абразивного зерна в обрабатываемую поверхность, м; W — плотность распределения абразива по обрабатываемой поверхности, $1/m^2$; k_y — коэффициент, зависящий от упругопластических свойств обрабатываемой поверхности, $k_y = \sigma_T / E$; A — амплитуда колебаний абразивонесущего катода-инструмента, м.



Рис. 2. Схема процесса контактного взаимодействия единичного зерна абразива и катода АЭКИ с микронеровностями обрабатываемой поверхности при ААП:
1 – микронеровности обрабатываемой поверхности; 2 – абразивное зерно эластичного абразивонесущего инструмента; 3 – катод-инструмент; 4 – силовые линии электрического поля;
5 – пассивирующая оксидная пленка; а и β – передний угол и угол резания в точке контакта К; r_i – радиус скругления вершины зерна; δ_{M33} – величина межэлектродного зазора;
h – глубина внедрения вершины абразивного зерна; Р_a – прижимающая сила зерно абразива; F_m – сила трения; Р – нормальная сила, действующая на абразивное зерно;
A, ω – амплитуда и частота колебаний ЭАИ; V_u – линейная скорость перемещения ЭАИ; W_{el} – скорость прокачки электролита 15% NaNO₃

Для ААП при удалении пассивных пленок вместо h_{\max} в формуле (12) целесообразно использовать среднюю глубину h_{cp} внедрения зерна за одну секунду в обрабатываемую поверхность, которую можно рассчитать по формуле для абразивонесущего АЭКИ:

$$h_{cp} = \sqrt{\frac{2N_p \cdot \omega}{\pi \cdot d_s \cdot H_v}}; \quad \text{M/c} , \qquad (13)$$

где N_p – мощность абразивного резания микронеровностей единичного зерна, Н·м/с; H_v – твердость обрабатываемого металла по Виккерсу, МПа; d – диаметр абразивного зерна, мкм.

Подставив (13) в (12), получим формулу для расчета установившейся шероховатости в течение 1 с [10, 11]:

$$Ra_{ycm} = K_{y} \sqrt{\frac{\omega^2}{WA} \sqrt{\frac{2N_p \cdot \omega}{\pi \cdot d_3 \cdot H_y}}}, \quad M/c$$
(14)

или

$$Ra_{ycm} = K_{y} \sqrt{\frac{\omega}{WA}} \sqrt{\frac{2 \cdot P_a \cdot f \cdot S_u \cdot r \cdot \omega^2}{\pi \cdot d_3 \cdot H_y}} \cdot T_0, \quad M, \qquad (15)$$

где T_0 – время анодно-абразивной обработки, с.

Результаты исследования и их обсуждение

С учетом формул (6), (15) можно получить формулу (16) для оценки шероховатости поверхности после ААП:

$$Ra_{n} = Ra_{ucx} - \left[K_{l}\frac{\varepsilon_{v}\cdot\eta\cdot i}{8S} + K_{y}\sqrt{\frac{\omega^{2}}{W\cdot A}\sqrt{\frac{2P_{a}\cdot S_{u}\cdot f\cdot r}{\pi\cdot d\cdot H_{v}}}}\right]\cdot T_{o}, \text{ MKM}, \qquad (16)$$

где Ra_n – установившаяся шероховатость; $Ra_{_{\rm HCX}}$ – исходная шероховатость поверхности, см; η – выход металла по току; *i* – плотность тока, A/см²; ε_v – объемный электрохимический эквивалент обрабатываемого металла, см³/А*мин; k_v – коэффициент, зависящий от упругопластических свойств обрабатываемой поверхности, $k_y = \sigma_T / E$; ω – частота продольных колебаний АЭКИ, 1/с; W – плотность распределения абразива АЭКИ, 1/мм²; A – амплитуда колебания АЭКИ; P_a – нормальное давление, действующее на абразивонесущую часть АЭКИ, Н/мм²; S – площадь абразивной части АЭКИ, мм²; f – коэффициент трения при ААП; r – радиус при вершине абразивного зерна, мм; d – диаметр абразивного зерна, мм; H_v – твердость обрабатываемого материала, Н/мм²; K_1 – коэффициент локализации процесса анодного растворения; 8 – коэффициент перевода высоты выступов в параметр Ra; T_0 – время обработки, с; S – скважность импульсов тока.

Для расчета шероховатости обрабатываемой поверхности при ААП были использованы исходные данные, представленные в таблице.

Исходные данные для расчета по формуле (16) шероховатости поверхности при анодно-абразивном микрополировании каналов волноводов, выполненных из сплава 32НКД

Электрические	Механо-абразивные
параметры	параметры для расчета
для расчета	абразивного удаления
электрохимической	оксидной пленки
обработки при ААП	при ААП
$\varepsilon_{z} = 0,00134 \text{ см}^{3}/\text{А}\cdot\text{мин};$ A = 17 мм; t = 30 с; S = 16,63; электролит15% NaNO ₃ ; $K_{L} = 0,09; i = 15 \text{ A/см}^{2};$ $\eta = 0,4$	$ \begin{split} H_{\nu} &= 438 \text{ H/MM}^2; \\ f_{\nu p} &= 0,15; \ \omega = 20 \ \Gamma \text{u}; \\ A^p &= 17 \text{ mm; } d = 0,040 \text{ mm;} \\ T_0 &= 30 \text{ c}; \ S_u &= 216 \text{ mm}^2; \\ r_i &= 1 \cdot 10^{-3} \text{ mm;} \\ W &= 2,5 \cdot 10^5 \text{ 1/mm}^2; \\ P_a &= 5 \text{ H/mm}^2; \\ k_{\nu} &= 2,08 \cdot 10^{-3} \end{split} $

Расчетная величина снимаемого припуска сплава З2НКД при удалении оксидной пленки абразивонесущим катодом-инструментом составила 0,14 мкм. Экспериментально установлено, что исходная обрабатываемая поверхность канала из сплава 32 НКД поперек канала была $Ra_{ucv} = 0,24$ мкм, после ААП $Ra_v = 0,12$ мкм; вдоль канала была Ra = 0,16 мкм, после ААП $Ra_{\mu} = 0,10$ мкм. Изменение шероховатости поверхности вдоль канала равно 0,06 мкм при средней плотности тока $i = 15 \text{ A/cm}^2$. Изменение шероховатости по формуле (16) равно 0,0452 мкм, что составляет 25% от измеренного значения. При выходе по току равным 0,6 при $i_c = 20$ A/см² несовпадение составит 10%. Диапазон изменения выхода по току небольшой, поэтому регулировать шероховатость поверхности нужно плотностью тока.

Заключение

Проведен теоретический анализ анодно-абразивного полирования каналов малого сечения. Полученная формула позволяет рассчитать снижение шероховатости поверхности в зависимости от режимов и условий анодно-абразивного полирования. Наибольшее влияние на шероховатость поверхности при ААП оказывает частота продольных колебаний АЭКИ, плотность тока и выход по току. Погрешность при оценке изменения шероховатости поверхности зависит от плотности тока.

Список литературы

1. Синькевич Ю.В., Шелег В.К., Янковский И.Н., Беляев Г.Я. Электроимпульсное полирование на основе железа, хрома и никеля. Минск: БНТУ, 2014. 325 с.

2. Трифанов И.В., Оборина Л.И., Рыжов Д.Р., Сутягин А.В., Малько Л.С., Трифанов В.И. Способ анодно-абразивного полирования отверстий // Патент РФ 2588953 Патентообладатель СибГАУ. 2010. Бюл № 19.

3. Строшков В.П., Категоренко Ю.И. Электрохимическое формообразование инструмента, литейной оснастки, деталей машин: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф-пед. ун-та, 2016. 257с.

4. Королев А.Ю., Алексеев Ю.Г., Нисс В.С., Паршуто А.Э. Электролитно-плазменная обработка в управляемых импульсных режимах // Наука и техника. 2021. Т. 20. № 4. С. 279–286.

5. Любимов В.В., Полутин Ю.В., Бородин В.В. Технология и экономика электрохимической обработки / Под ред. Ф.В. Седыкина. М.: Машиностроение, 1980. 192 с.

6. Волгин В.М., Сидоров В.Н., Кабанова Т.Б., Давыдов А.Д. Влияние формы импульсов напряжения на электрохимическую обработку // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. № 10. С. 611–618.

7. Трифанов В.И., Карелина Е.А., Суханова О.А., Трифанов И.В. Исследование параметров процесса анодноабразивного полирования каналов малого сечения // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 11. С. 79–86.

 Надараиа Ц.Г., Бабкина Л.А., Шестаков И.Я. Электрохимическое полирование металлов в водных растворах нейтральных солей с вибрацией электрода: монография. Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет, 2014. 117 с.

9. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. М.: Машиностроение, 1974. 319 с.

10. Димов Ю.В. Обработка деталей эластичным инструментом: справочник. Иркутск: Издательство Иркутского государственного технического университета, 2013. 484 с.

11. Тамаркин М.А., Тищенко Э.Э., Верченко А.В., Коханюк А.Г. Обеспечение шероховатости поверхности детали при гидроабразивной резке заготовок из стали // Машиностроение и техносфера XXI века: сборник трудов XXVI международной научно-технической конференции (Донецк – Севастополь, 23–29 сентября 2019 г.). Донецк – Севастополь: Донецкий национальный технический университет, 2019. С. 398–401.

12. Силы и мощность резания. [Электронный ресурс]. URL: https://studfile.net/preview/3978301/page:9/ (дата обращения: 05.05.2022).